

装置管理システムマニュアル

Equipment System Manual

物質・材料研究機構

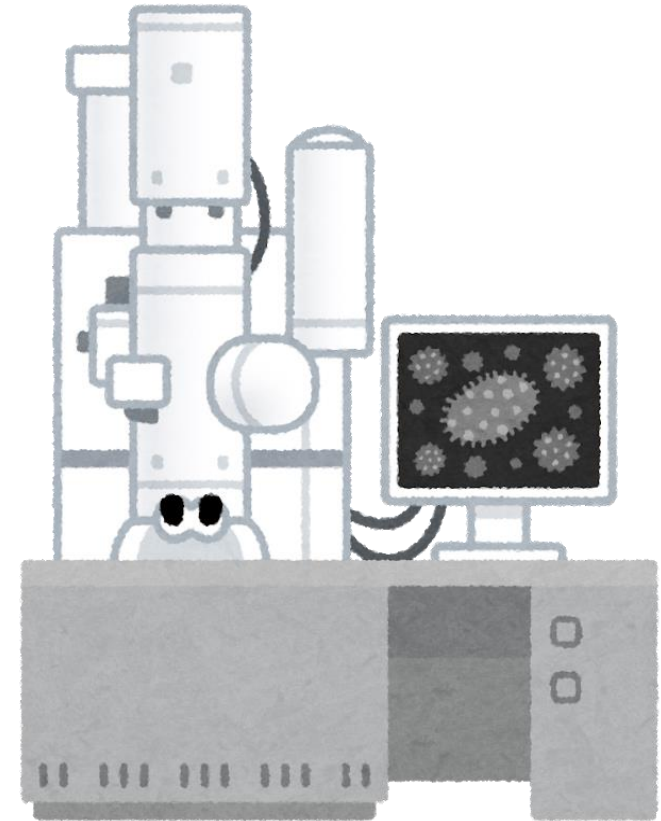
電子顕微鏡解析ステーション ナノ構造解析グループ

NIMS Electron Microscopy Analysis Station,
Nanostructural Characterization Group

目次

Contents

- ユーザー登録(内部利用) 2
User Registration (Internal)
- 利用申請(内部利用) 4
Application for use (Internal)
- 装置の予約 10
Equipment Reservation
- 装置の予約(修正・取消) 14
Equipment Reservation (Revise and Cancel)
- 利用料金について 18
The Support Charge



ユーザー登録/User Registration

【URL】

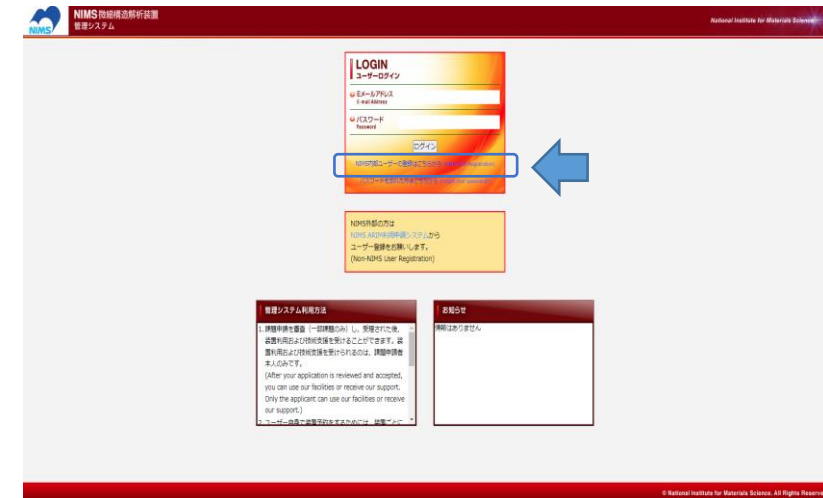
<https://www.nmcp.jp/>

「NIMS内部ユーザーの登録はこちらから」をクリックします。

ユーザー登録済みの方はメールアドレス(大文字・小文字を区別します)とパスワードでログイン。

Please click “NIMS User Registration”.

If you are a registered user, log in with your email address (case sensitive) and password.



ユーザー登録

NIMS情報連携システム管理システムをご利用いただくためのユーザー登録フォームです。

必要事項をご記入の上、ご登録ください。

※は必須入力項目になります。

<p>● 暗号化について Encryption</p> <p>● 職員番号 NIMS staff ID</p> <p>● パスワード Password (再入力)</p> <p>● 氏名 Name</p> <p>● 氏名(カナ) Name (English)</p> <p>● 年齢層 Age</p> <p>● ユーザー区分 User Classification</p> <p>● 所属機関 Affiliated Institution</p> <p>● 所属部署 Affiliated Department</p>	<p>● 役職 Job Position</p> <p>● 所属機関郵便番号 Office Zip Code</p> <p>● 所属機関住所 Office Address</p> <p>● 電話番号 Telephone number</p> <p>● Eメールアドレス E-mail Address</p> <p>● 居住者非居住者の別 Residential Status</p> <p>● 雇用関係の有無 Presence of employment relationship</p>	<p>このサイトは、ブラウザとサーバー間での情報の送受信が暗号化されています。左記の画像をクリックして証明書の内容をご確認ください。</p> <p>【例】 大学院生、修士1年、ポストドク、教授、研究員 ([Ex] Graduate Student, Postdoctoral Reseracher, Professor, Reseracher)</p> <p>【例】 305-0047 ([Ex] 305-0047)</p> <p>【例】 茨城県つくば市千代1-2-1 ([Ex] 1-2-1 Sengen, Tsukuba, Ibaraki)</p> <p>【例】 029-859-2310 ([Ex] 029-859-2310)</p> <p>パソコンでメール発信できるアドレス (E-mail address of your personal computer)</p> <p>すでに日本に6ヶ月以上滞在している (Have you already been staying in Japan over 6 months?)</p> <p>● はい (Yes) ● いいえ (No)</p> <p>現在の所属機関に現在雇用されている (Are you currently employed by the present affiliated institution?)</p> <p>● はい (Yes) ● いいえ (No)</p> <p>契約に基づき、外国政府・大学等の支配下にある者 (Person under the control of a foreign government, corporation or university by contract)</p> <p>● はい (Yes) ● いいえ (No)</p>
---	--	--

各項目に情報を入力して、「本システムのプライバシー保護に関する取り決めについて」を確認後「同意する」にチェックを付けます。次へ→登録

Please agree after reading “The Rule of Privacy Protection of This System” regarding the handling of personal information
 agree with the handling of the privacy information.

<p>● 特定類型の該当 Categories</p> <p>● 個人情報の取扱い Handling of personal information</p>	<p>経済的利益に基づき、外国政府等の実質的な支配下にある者 (Person substantially under the control of foreign government by economic interests)</p> <p>● はい (Yes) ● いいえ (No)</p> <p>上記の他、国内において外国政府等の指示の下で行動する者 (Person acting in Japan under instructions of a foreign government)</p> <p>● はい (Yes) ● いいえ (No)</p> <p>送信いただく個人情報について「本システムのプライバシー保護に関する取り決めについて」をご覧いただき同意してください。 (Please agree after reading “The Rule of Privacy Protection of This System” regarding the handling of personal information.)</p> <p>■ 以上の内容に同意する (agree with the handling of the privacy information)</p>
--	--

次へ(Next)

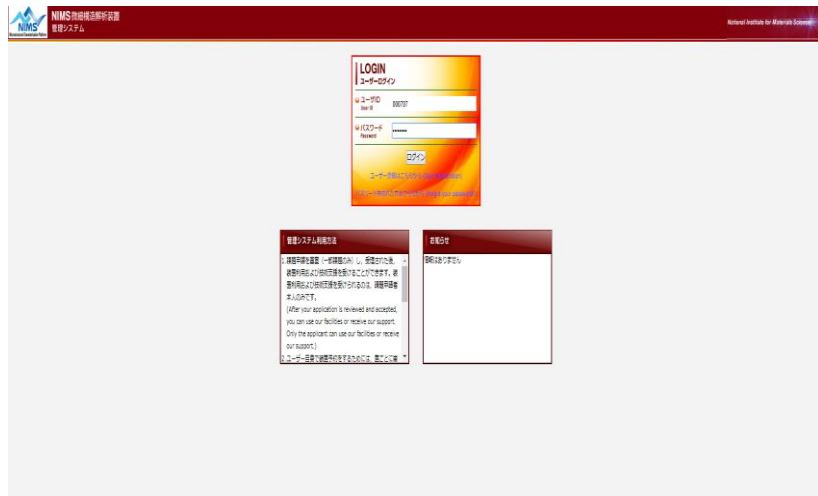
ユーザー登録が完了すると、
本登録のお知らせメールが届きます。
After user registration,
You will get a mail of completion.



【URL】

<https://www.nmcp.jp/>

メールアドレスと登録したPasswordでログインしてください。
Please login with your user email address and password.



ユーザー本登録のお知らせ/Notification of user registration

ユーザー本登録のお知らせ

NIMS 共用装置管理システムよりお知らせいたします。

ユーザー登録の手続きが完了いたしましたので、お知らせいたします。

ユーザーID： *****

ご登録いただいたメールアドレスとパスワードを使用してログインし、「新規利用申請」へ進んでください。

*パスワードはログイン後、ご自身で変更可能です。

NIMS 共用装置管理システムログインページ：<https://www.nmcp.jp/>

装置管理システムの手順(マニュアル)：<https://www.nims.go.jp/nmcp/content/files/shinseitejun.pdf>

This is a message from NIMS microstructural characterization facility services system.

Your user registration has been completed.

User ID: *****

When you receive this registration notice, please log in with your email address and password, you can access "New Application".

You can change the password by yourself after you logged in.

【Registration System URL】<https://www.nmcp.jp/>

Please refer to the link (the manual).

https://www.nims.go.jp/nmcp/eng/content/files/shinseitejun_eng.pdf

【ご注意】

本メールは送信専用となります。このメールへの返信はご遠慮ください。
お問合せは下記までお願いいたします。

[Notice]

Please do not reply to this e-mail.

If you have any inquiries, please contact us below.

利用申請(内部利用)/Application for use

利用申請・支援履歴より新規利用申請を行ってください。
Please apply from “Application for use/Support history” page.

▶ 利用申請・支援履歴 - 一覧 Application for use / Support history (List)

2022年度 ▼ 表示する / Show

新規利用申請をクリック
Click 「New application」

新規利用申請 / New application

※利用料金は税抜き表示(not including consumption tax)

2022年度 / 2022FY

コード Code	課題ID Application ID	分野 Station	区分 Type	申請日 Application date	状態 Status	データ共有 Data Share	利用料金 Usage fee	最終利用日 The date of last use	修正 Revised
	支援課題名 A title of application		申請者 Applicant	公開 / 非公開			支援日 The date of support	削除 Deleted	

ユーザ さん

マイページ
My Page

利用申請・支援履歴
Application for use / Support history

装置予約
Equipment reservation

課題別利用料金
Support charge by each subject

ログアウト
Output Registration

利用申請・支援履歴 - 規約の承認 Application for use / Support history (Acceptance of the Terms)

利用規約 General Conditions for Use of Equipment and Facilities	各装置の利用ルールを順守してください。 Please obey the usage rule of each equipment.
注意事項 Notice	年度ごとに利用報告書の提出が義務付けられています。 It is required to submit the usage reports annually.
規約の承認 Acceptance of The Terms	<input type="checkbox"/> 利用規約を承認します。また、報告書の提出に同意します。 I approve the terms and agree to submit the report.
研究不正防止等に係る宣誓 Promise never to do research misconduct	<input type="checkbox"/> NIMSの定める規則、事項を遵守します。 I obey NIMS regulations and terms. <input type="checkbox"/> 研究活動における特定不正行為（捏造、改ざん及び盗用）、及びそれ以外の不正行為（不適切なオーサーシップ、二重投稿等）を行いません。 I will not do any research misconduct (fabrication, falsification, plagiarism, unapt authorship, and duplicate submission).

利用規約に同意し、利用を申し込む / I agree with above provisions, and would like to apply.

利用規約・注意事項の確認と承認をして、「利用規約に同意し、利用を申し込む」をクリック

After confirming the contents and approving, please click “I agree with above provisions, and would like to apply.”.

利用実績に基づく月毎（1ヶ月毎）の請求
Defferend Payment(Pay every month)

※内部課金の支払いルールに基づき、振替申請によりお支払いいただきます。

※Please pay by transfer application (振替申請) based on the payment regulations of the internal charge(内部課金).

支払い方法に同意する / I agree with above.

メッセージを読んで「支払方法に同意する」をクリック
Please read the message and click “I agree with above.”.

申請年度 Application FY	2022年度
申請者 Applicant	User

申請年度を確認してください。
Please confirm application year, FY20**.

は必須項目 (means "required fields")

研究支援概要 Overview of Research Support	
*分野 Field	指定なし
*支援課題名 Title of Research-Support Subject	現在の文字数[Current number of characters] 0 ※ 40字以内で記述してください。 * Please input 40 characters or less.
*研究概要 Overview of Your Research	現在の文字数[Current number of characters] 0 250文字以内をお願いします。 Please input 250 characters or less.
*データ共有 Data share	<input type="radio"/> 共有あり(Yes) <input checked="" type="radio"/> 共有なし(No)
*NIMS ワークフローシステム課題番号 Applicant ID which was obtained from the NIMS Workflow System	22NM****
備考 Note	
*希望支援形態 Support Style	機器利用(Common use) 支援依頼内容[Content of support request] : ※技術代行の方は記入してください * For Technical surrogate users

【機器利用・技術補助 Common use/Technical Support】
分野(TEM千現)を選ぶと装置名が表示されます。利用する装置をすべて選択します。
Please choose TEM-Sengen and equipment you.

【技術代行 Technical Surrogate】
分野(TEM千現)をお選びください。装置名の選択は不要です。
Please choose TEM-Sengen. There are no need to select any equipments.

NIMSワークフローシステムで取得した課題番号を入力してください。
Please fill in your Application ID from the NIMS Workflow System.

* は入力必須項目です。
* means "required fields"

副ユーザー	
副ユーザー	
利用責任者情報 Supervisor Information	
*利用責任者名 Supervisor Name	<input type="text"/>
*利用責任者Eメールアドレス Supervisor's E-mail Address	<input type="text"/>
特記事項等、その他コメント欄 Special instruction, Other comments	<input type="text"/>

申請者が任期制職員の場合は 定年制職員の入力をお願いします。
 また、申請者が定年制職員で、利用について責任が取れる場合はご本人でも構いません。
 Please fill in the person who is a Permanent employee.

入力内容を確認する(Confirm)

修正する(Back)

記入が完了したら、「入力内容を確認する(Confirm)」をクリックします。
 After completing the entry, click "Confirm".

その後、「上記内容で申請する(Submit)」をクリックします。
 And then click "Submit".

申請を受け付けました。
Application has been accepted.

新規利用申請受付のお知らせメールを送信しました。
"Registration of use application" mail has been sent.

[Back to My Page](#)

申請を受け付けしました。
The application has been accepted.

装置の予約/Equipment Reservation

ライセンス所持者のみご自身で機器利用の予約が可能です。
Users with a license can make a reservation on their own.

- ユーザ temuser さん
- マイページ My Page
- 課題申請・文書閲覧 Subject application / support system
- 装置予約 Equipment reservation**
- 設備利用料 Support charge by each subject
- ログアウト Output Registration

装置予約 Equipment reservation

前月へ Previous month 2018年 03月 March, 2018 次月へ Next month

予約したい装置もしくは日にちをクリックして下さい (Click the machine name or the date you want to book.)

■ : 本人の予約 (Your booking) ■ : 他人の予約 (Others)

装置名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
実動環境対応物理分析電子顕微鏡 (JEM-ARM200F-G)																															
実動環境対応電子線木ログラフィー電子顕微鏡 (JEM-ARM200F-B)																															
300kV電界放出形透過電子顕微鏡 (Technai G2 F30)																															
300kV電界放出形電子顕微鏡 (JEM-3000F)																															
200kV電界放出形透過電子顕微鏡 (JEM-2100F1)																															
200kV電界放出形透過電子顕微鏡 (JEM-2100F2)																															
200kV透過電子顕微鏡 (JEM-2100)																															
走査電子顕微鏡 (JSM-7000F)																															
FIB加工装置 (JIB-4000)																															
FIB加工装置 (JEM-9320FIB)																															
FIB加工装置 (JEM-9310FIB1)																															
FIB加工装置 (JEM-9310FIB2)																															
ピックアップシステム (Pick-up System)																															
デュアルビーム加工観察装置 (NB5000)																															
TEM試料作製装置群 (TEM試料作製装置群)																															
ウルトラマイクローム (Ultramicrotome)																															
HRTEM解析システム (HRTEM解析システム)																															
電子線トモグラフィー解析システム (電子線トモグラフィー解析システム)																															
低温電界放出形ローレンツ電子顕微鏡																															

【予約方法/Reservation Method】
①はじめに、予約したい装置名(日付)をクリックします。
First, please click an equipment(date).

※グレーの箇所は他の予約があります。
Gray areas have other reservations.

- ユーザ temuser さん
- マイページ My Page
- 課題申請・支援履歴
- 装置予約 Equipment reservation**
- 課題別利用料金 Support charge by each subject
- ログアウト Output Registration

装置予約 - 装置詳細 Equipment reservation (Equipment Details)

200kV電界放出形透過電子顕微鏡 (JEM-2100F2)

前月へ Previous month 2018年 03月 March, 2018 次月へ Next month

日付をクリックして予約してください。(Click a date and make a reservation.)

■ : 本人の予約 (Your booking) ■ : 他人の予約 (Others)

		09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	木												
2	金												
3	土												
4	日												
5	月												
6	火												
7	水												
8	木												
9	金												
10	土												
11	日												
12	月												
13	火												
14	水												
15	木												
16	金												
17	土												
18	日												
19	月												
20	火												
21	水												
22	木												
23	金												
24	土												
25	日												
26	月												
27	火												

②次に、予約したい日付(装置)をクリックします。
Next, please click a date (equipment).

※グレーになっている箇所は一部でも重複があると予約できません
黄色のラインは本日を意味します。

Gray cell has already been reserved. You can not make a reservation at the same time.
Yellow line shows today.

- ユーザ temuser さん
- マイページ
My Page
- 課題申請・支援履歴
- 装置予約
Equipment reservation**
- 課題別利用料金
Support charge by each subject
- ログアウト
Output Registration

装置予約 - 新規登録 Equipment reservation (New Registration)

予約日 Day	2018-03-14
開始時間～終了時間 Start ~ End	<input type="radio"/> AM <input type="radio"/> PM
装置名 Equipment	200kV電界放出形透過電子顕微鏡 (JEM-2100F2)
予約者 Subscriber	temuser
利用者 User	temuser
課題 Subject	課題を選択してください
利用形態 Use Style	機器利用
コメント Comments	

③利用時間を選択します。
Choose AM or PM

④課題を選択します。
Choose a subject

⑤入力が完了したらこちらをクリック
Click here

入力内容を確認する / Confirm

戻る / Back

【補足事項/Supplemental remarks】

- * AM & PMで利用したい場合、両方にチェックを入れてください。
If you'd like to reserve both AM and PM, you need to check both.
- * TEM試料作製装置群については、利用開始時間と終了時間を選択してください
TEM sample preparation apparatus require choosing the start time and end time instead of AM/PM.
- * 装置の予約は前日までに行ってください。当日に予約はできません。
Please make a booking for the facilities by the day before. You can not make a booking on the day.
- * 必要に応じてコメント欄を活用ください。
Please use Comments if necessary.

TEM試料作製装置群について

About TEM sample preparation apparatus

- 1時間単位での予約になります。
Reservations can be made in 1 hour increments
- 装置予約は9:00-16:00までです。
Reservable hours: 9am to 4pm.
- 試料作製室のご利用は9:00-16:30までになります。
Room available hours: 9am to 4:30pm.
- 装置管理システムで入力した時間は、利用料金にそのまま反映されるため、昼休みや休憩時間を含む利用は予約を分けてください。
Reserved time slots will be fully charged, so be sure to exclude lunch breaks or recesses when you make a reservation.

- ユーザ temuser さん
- マイページ My Page
- 課題申請・支援履歴
- 装置予約 Equipment reservation**
- 課題別利用料金 Support charge by each subject
- ログアウト Output Registration

▶ 装置予約 - 新規登録 Equipment reservation (New Registration)

予約日 Day	2018-03-14
開始時間～終了時間 Start ~ End	09:00 ~ 12:30
装置名 Equipment	200kV電界放出形透過電子顕微鏡 (JEM-2100F2)
予約者 Subscriber	temuser
利用者 User	temuser
課題 Subject	[ID-TEM-test1] 例) * * * * * の観察
利用形態 Use Style	機器利用
コメント Comments	

利用予定日の前日からキャンセルできませんので、ご注意ください。
Please note that you will be not able to cancel the reservation from the day before the scheduled date of use.

内容を確認後、
予約を確定します。
After confirmation,
finalize your reservation.

上記の内容で予約する / Set

戻る / Back



- ユーザ temuser さん
- マイページ My Page
- 課題申請・支援履歴
- 装置予約 Equipment reservation**
- 課題別利用料金 Support charge by each subject
- ログアウト Output Registration

▶ 装置予約 - 新規登録 Equipment reservation (New Registration)

登録しました / Completed

トップへ戻る / Back to Top Page

予約の修正・取消/Revision & Cancellation

ユーザ temuser さん

マイページ My Page

課題申請・支援履歴

装置予約 Equipment reservation

各装置の稼働料
Support charge by each subject

ログアウト Output Registration

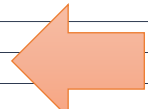
装置予約 Equipment reservation

前月へ Previous month 2018年 04月 April, 2018 次月へ Next month

予約したい装置もしくは日にちをクリックして下さい (Click the machine name or the date you want to book.)

■ : 本人の予約 (Your booking) ■ : 他人の予約 (Others)

装置名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
実験環境対応物理分析電子顕微鏡 (JEM-ARM200F-G)																														
実験環境対応電子線ホログラフィー電子顕微鏡 (JEM-ARM200F-B)																														
300kV電界放出形透過電子顕微鏡 (Tecnai G2 F30)																														
300kV電界放出形電子顕微鏡 (JEM-3000F)																														
200kV電界放出形透過電子顕微鏡 (JEM-2100F1)																														
200kV電界放出形透過電子顕微鏡 (JEM-2100F2)																														
200kV透過電子顕微鏡 (JEM-2100)																														
走査電子顕微鏡 (JSM-7000F)																														
FIB加工装置 (JIB-4000)																														
FIB加工装置 (JEM-9320FIB)																														
FIB加工装置 (JEM-9310FIB1)																														
FIB加工装置 (JEM-9310FIB2)																														
ピックアップシステム (Pick-up System)																														
デュアルビーム加工観察装置 (NB5000)																														
ウルトラマイクローム (Ultramicrotome)																														
HRTEM解析システム (HRTEM解析システム)																														
電子線トモグラフィー解析システム (電子線トモグラフィー解析システム)																														
イオンスライサー Ion Slicer (TEM試料作製装置群)																														
超深イオン研磨装置③ PIPS(Model 691) 103																														



- ①修正・取り消したい装置をクリックします。
Click an equipment which you would like to revise or cancel.

ユーザ

マイページ
My Page

利用申請・支援履歴
Application for use / Support history

**装置予約
Equipment reservation**

装置別利用料
Support charge by each subject

ログアウト
Output Registration

前月へ Previous month

2022年 06月 June, 2022

次月へ Next month

日付をクリックして予約をしてください。(Click a date and make a reservation.)

■ : 本人の予約 (Your booking) ■ : 他人の予約 (Others)

		09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	水												
2	木												
3	金												
4	土												
5	日												
6	月												
7	火												
8	水												
9	木												
10	金												
		09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	土												
12	日												
13	月												
14	火												
15	水												
16	木												
17	金												
18	土												
19	日												
20	月												
		09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	火												
22	水												
23	木												
24	金												
25	土												
26	日												
27	月												
28	火												
29	水												
30	木												

②修正・取り消したい予約にカーソルを合わせてクリック。
Click the reservation you would like to revise or cancel.



装置予約状況ページへ戻る (Back to the booking status page.)

- ユーザ temuser さん
- マイページ
My Page
- 課題申請・支援履歴
- 装置予約
Equipment reservation**
- 課題別利用料金
Support charge by each subject
- ログアウト
Output Registration

装置予約 - 詳細 Equipment reservation (Details)

予約日 Day	2018-05-16
開始時間～終了時間 Start ~ End	13:00 ~ 16:30
装置名 Equipment	200kV電界放出形透過電子顕微鏡 (JEM-2100F1)
予約者 Subscriber	temuser
利用者 User	temuser
課題 Subject	[] test課題
利用形態 Use Style	機器利用
コメント Comments	

利用予定日の前日からキャンセルできませんので、ご注意ください。
Please note that you will be not able to cancel the reservation from the day before the scheduled date of use.

予約を修正する / Booking Change



Revise

予約を削除する / Booking Delete



Cancel

戻る / Back

③内容に間違いがないかを確認し、クリック。
Confirm all the contents and click "Revise" or "Cancel".

- ユーザ temuser さん
- マイページ
My Page
- 課題申請・支援履歴
Subject application / Support history
- 装置予約
Equipment reservation**
- 課題別利用料金
Support charge by each subject
- ログアウト
Output Registration

装置予約 - 削除 Equipment reservation (Deletion)

装置名 (Equipment) : 【200kV電界放出形透過電子顕微鏡/JEM-2100F1】
予約時間 (Booking Time) : 【13:00~16:30】
を本当に削除しますか？

予約を削除する / Booking Delete

戻る / Back



- ユーザ temuser さん
- マイページ
My Page
- 課題申請・支援履歴
Subject application / Support history
- 装置予約
Equipment reservation**
- 課題別利用料金
Support charge by each subject
- ログアウト
Output Registration

装置予約 - 削除 Equipment reservation (Deletion)

削除しました

戻る

この画面になれば作業は完了です。
This page means “Completed”.

注: 予約者本人によるキャンセル・変更は予約日の2日前まで可能です。

予約日前日からのキャンセル・変更はナノ構造解析グループ事務局(tem@nims.go.jp)にご連絡をお願いいたします。

使用開始時間の24時間前までのキャンセルは課金されませんが、それ以降のキャンセルは課金される場合がありますのでご了承ください。

Note: Users can cancel or reschedule their reservation up to 2 days before the reservation date.

From the day before the reservation, please contact Nanostructural Characterization Group office(tem@nims.go.jp) for your cancel.

The cancellation must be made at least 24 hours prior to the reservation, otherwise a cancellation fee may be charged.

利用料金について

The Support Charge



NIMS 微細構造解析装置
管理システム

National Institute for Materials Sci

ユーザー

- マイページ My Page
- 利用申請・支援履歴 Application for use / Support history
- 装置予約 Equipment reservation
- 課題別利用料金 Support charge by each subject**
- 出力登録 Output Registration

課題別利用料金 Support charge by each subject

2022年度 ▼ 表示する/Show

2022年度 課題別利用料金一覧 [2022-06-15 現在] Total Usage Fees														
コード Code	課題ID ▲ Application ID		支援課題名 A title of subject								申請者 Applicant			データ共有
	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	1月 January	2月 February	3月 March	合計 Total	
1817			テスト											なし
	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	
	印刷 Print	印刷 Print	印刷 Print	印刷 Print	印刷 Print	印刷 Print	印刷 Print	印刷 Print	印刷 Print	印刷 Print	印刷 Print	印刷 Print	印刷 Print	
1905			テスト											なし
	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	
	印刷 Print	印刷 Print	印刷 Print	印刷 Print	印刷 Print	印刷 Print	印刷 Print	印刷 Print	印刷 Print	印刷 Print	印刷 Print	印刷 Print	印刷 Print	



2022年度3月 電子顕微鏡導入システム 利用明細書

内部利用とAIRM利用は、このページで月ごとおよび年度合計の利用料金を見ることが出来ます。「印刷」をクリックすると利用明細書が表示されます。(NOF利用は除く)

You can see the support charge on this page. If you click the print button, the usage details will be displayed. (Excluding NOF use)

項目	内容	金額	単位
利用料	1.500円	1.500	円
手数料			
消費税			
合計	1.500円	1.500	円

請求金額 1,500円

本システムは、NIMS 微細構造解析装置 管理システムの一部です。
 本システムは、NIMS 微細構造解析装置 管理システムの一部です。
 This system is a part of the NIMS Microstructure Analysis System Management System.
 This system is a part of the NIMS Microstructure Analysis System Management System.